金属-半导体界面欧姆接触的原理、测拭与工艺



作者: 吴鼎芬, 颜本达编著

出版社:上海:上海交通大学出版社

出版日期: 1989.03

总页数: 216

说明: 登录教客网(https://www.jiaokey.com/book/detail/10697878.html) 查找全本阅读方式

金属-半导体界面欧姆接触的原理、测拭与工艺 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10697878.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10697878.html

书名: 金属-半导体界面欧姆接触的原理、测拭与工艺